

新規

連携

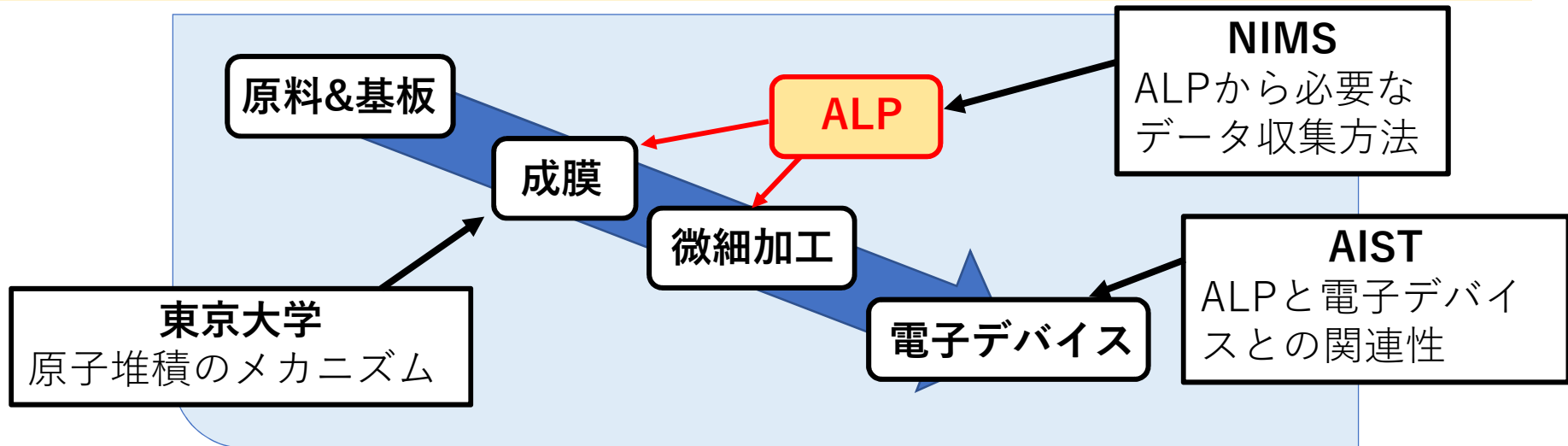
TK21-000

題目：データサイエンスを活用した原子層プロセス(ALP) 技術開発への取り組み

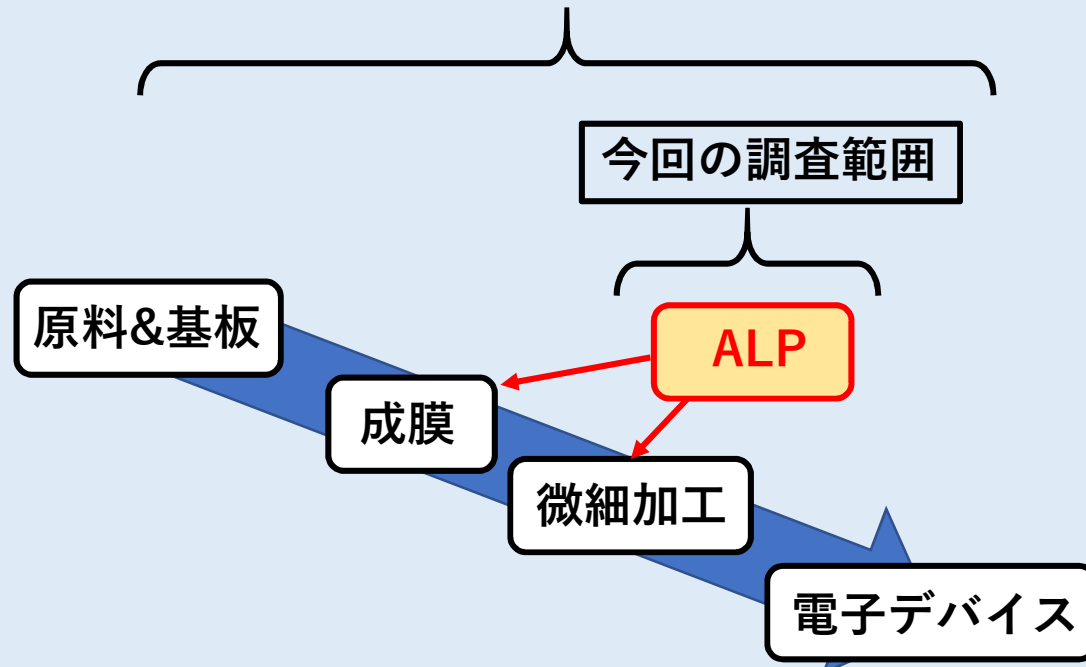
調査研究代表：NIMS 生田目 俊秀

NIMS代表者：技術開発・共用部門 ナノファブリケーショングループ
生田目 俊秀

5G、IoTの電子デバイスは多種多様な装置を用いて作製されている。各装置毎にデータ収集して安定な作製プロセスを導き出す事は理想の最終系であるが、現実には難しかった、そこで、特にパラメーターの多い**原子層プロセス(ALP)**に注目して、原子堆積のメカニズム（東大）、**必要なデータ収集方法（NIMS）**及び電子デバイスとの関連性（AIST）について連携して調査する。



将来
全プロセスの必要なデータ収集と活用



【年間活動計画】

ALP技術の動向調査
6月 ALD/ALE国際
ワークショップ
9月 2021秋季応物
10月 マイクロプロセ
スナノテクノロジー
国際会議

- ALPで必要なデータ収集への選択は、**電子デバイス作製プロセス全般へ展開できる**大きな可能性を秘めています。
- **デバイス・装置・原料メーカーとも連携**した大きな枠組みを構築できる期待があります。